

公益社団法人日本表面真空学会 学会賞規程

平成 25 年 2 月 2 日理事会承認
改訂 平成 30 年 9 月 29 日理事会

(定義)

第 1 条 公益社団法人日本表面真空学会（以下本会という）は、表面・真空科学の基礎および応用研究ならびに技術の進歩発展に関する功績を顕揚するために日本表面真空学会学会賞を設定する。本賞は、表面・真空科学において相当期間にわたって高い水準の業績を挙げることにより、本会に貢献した功績の顕著な個人に与えられる賞である。

(対象者)

第 2 条 本賞は本会の個人会員に与えられる。ここに個人会員とは、名誉会員、功労会員、個人正会員、および学生会員のいずれかであり、物故者も含む。

2 業績の一部に共同研究者があっても、原則として単独受賞とする。

(推薦)

第 3 条 受賞候補者の推薦は下記による。

(1) 本会名誉会員、功労会員、個人正会員、および法人正会員は、学会賞の受賞候補者を推薦することができる。

(2) 受賞候補者の推薦に際しては、定められた形式による推薦書および推薦理由書等を、所定の書類に添えて提出する必要がある。

(選定)

第 4 条 学会賞等選定委員会は、推薦された候補者から年 1 回 2 3 名以内を受賞対象者として選定し、理事会に推薦する。

2 理事会は選考結果の報告を受け審議し、受賞者を決定する。

(表彰)

第 5 条 表彰は、賞状もしくは楯、または賞状と楯とをもって行う。

(授賞)

第 6 条 本賞の授賞は、学術講演会または定例総会にて行う。

(受賞業績の公開)

第 7 条 受賞者は、学術講演会にて受賞業績の発表を行なうものとする。

(内規)

第 8 条 本賞の推薦方法および選考方法について、必要ならば内規を別に定めるものとする。

(規程の改廃)

第 9 条 この規程の改廃は理事会の議決をもって行うものとする。

付則 この規程は平成 30 年 9 月 29 日から施行し、平成 30 年 9 月 29 日から適用する。

改訂来歴

日付	理由及訂正箇所	承認	起案
2008/8/23	初版作成	理事会	長谷川修司
2008/11/22	改訂版作成	理事会	工藤正博
2009/4/18	改訂版作成	理事会	工藤正博
2013/2/2	改訂版作成	理事会	一宮彪彦
2018/9/29	改訂版作成	理事会	長谷川修司

公益社団法人日本表面真空学会 功績賞規程

2019年2月2日理事会承認

(目的)

第1条 公益社団法人日本表面真空学会（以下本会という）は表面・真空科学技術振興のため、日本表面真空学会功績賞（以下功績賞）を設け、本規程によって授賞する。

(資格)

第2条 功績賞は、永年にわたり本学会の発展に特に功績があったと認められる個人正会員に年一回授賞する。なお、これらの条件を充たす物故者にも授賞しうる。

(選定)

第3条 受賞者の選定は、学会賞規程に定められた学会賞等選定委員会が行う。

2 選定委員会は、推薦された候補者から受賞対象者を選定し、理事会に推薦する。

(推薦方法)

第4条 受賞候補者の推薦は下記による。

(1) 本会名誉会員、功労会員、および個人正会員および法人正会員は、功績賞の受賞候補者を推薦することができる。

(2) 受賞候補者の推薦に際しては、定められた形式による推薦書および推薦理由書等を、所定の書類に添えて提出する必要がある。

(受賞者の決定)

第5条 会長は第3条の規程による選考結果の報告を受け、これを理事会に諮り、受賞者を決定する。

2 授賞すべき適当な候補者がいない場合には、その年度は授賞しない。

(表彰)

第6条 表彰は、賞状もしくは楯、または賞状と楯とをもって行う。

(発表)

第7条 本賞の授賞は、学術講演会または定例総会にて行う。

(内規)

第8条 本賞の推薦方法および選考方法について、必要ならば内規を別に定めるものとする。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は理事会の議決をもって行うものとする。

付則

この規程は2019年2月2日から施行し、2019年2月2日から適用する。

改訂来歴

日付	理由及訂正箇所	承認	起案
2008/8/23	初版作成	理事会	長谷川修司
2013/2/2	改訂版作成	理事会	一宮彪彦
2018/9/29	改訂版作成	理事会	長谷川修司
2019/2/2	改訂版作成	理事会	長谷川修司

公益社団法人日本表面真空学会 論文賞等規程

2019年2月2日理事会承認

(目的)

第1条 公益社団法人日本表面真空学会(以下本会という)は奨学のため、日本表面真空学会論文賞(以下論文賞)、日本表面真空学会熊谷記念真空科学論文賞(以下熊谷論文賞)、日本表面真空学会会誌賞(以下会誌賞)および日本表面真空学会技術賞(以下技術賞)を設け、本規程によって授賞する。また、本会は若手研究者奨励のために日本表面真空学会奨励賞(以下奨励賞)を、表面・真空科学の産業応用を奨励するために日本表面真空学会産業賞(以下産業賞)を設け、同じく本規程によって授賞する。

(対象)

第2条 各賞は以下の対象から選考される。

- (1) 論文賞は、受賞年の前年度(1月～12月)を含む過去2年間に本会会誌または本会発行の **e-Journal of Surface Science and Nanotechnology** に掲載された原著論文が、表面・真空科学の進歩発展に特に大きく貢献したと認められる個人会員に年一回授賞する。なお、これらの条件を満たす物故者にも授賞しうる。
- (2) 熊谷論文賞は、受賞年の前年度(1月～12月)を含む過去2年間に本会会誌または本会発行の **e-Journal of Surface Science and Nanotechnology** に掲載された原著論文が、真空科学の進歩発展に特に大きく貢献したと認められる個人会員に年一回授賞する。なお、これらの条件を満たす物故者にも授賞しうる。
- (3) 会誌賞は、受賞年の前年度(1月～12月)を含む過去2年間に本会会誌または本会発行の **e-Journal of Surface Science and Nanotechnology** に掲載された原著論文以外の記事が、本学会会員の啓蒙に特に大きく貢献したと認められる個人会員に年一回授賞する。なお、これらの条件を満たす物故者にも授賞しうる。
- (4) 奨励賞は、前年度(1月～12月)中に本会会誌または本会発行の **e-Journal of Surface Science and Nanotechnology** に掲載された原著論文の第一著者が、原稿受理日において37歳以下であり、その論文が注目され、将来表面・真空科学への貢献が大いに期待されると認められる個人会員に年一回授賞する。
- (5) 技術賞は、受賞年の前年度(1月～12月)を含む過去2年間に本会会誌または本会発行の **e-Journal of Surface Science and Nanotechnology** へ掲載された原著論文またはこれに準ずるものが、表面・真空科学における基礎技術あるいは応用技術の進歩発展に大きく貢献したと認められる会員に年一回授賞する。
- (6) 産業賞は、表面・真空科学関連産業の進歩発展に大きく貢献したと認められる製品、技術ノウハウまたはそれに類する成果をあげた本会法人正会員、維持会員、賛助会員に対して年一回授賞する。

(選定委員会)

第3条 論文賞等選定委員会は、推薦された候補者から受賞対象者を選定し、理事会に推薦する。

(候補者の推薦)

第4条 受賞候補者の推薦は下記による。

- (1) 本会名誉会員、功労会員、および個人正会員および法人正会員は、各賞の受賞候補者を推薦する

ことができる。

(2) 受賞候補者の推薦に際しては、定められた形式による推薦書および推薦理由書等を、所定の書類に添えて提出する必要がある。

(受賞者の決定)

第5条 会長は第3条の規程による選考結果の報告を受け、これを理事会に諮り、受賞者を決定する。

2 各賞を授賞すべき適当な論文または記事がない場合には、その年度は授賞しない。

(表彰)

第6条 表彰は、賞状もしくは楯、または賞状と楯とをもって行う。

2 本賞の授賞は、学術講演会または定例総会にて行う。

3 受賞者またはその代表者は、学術講演会にて受賞業績の発表を行なうものとする。

(内規)

第7条 本賞の推薦方法および選考方法について、必要ならば内規を別に定めるものとする。

(規程の改廃)

第8条 この規程の改廃は理事会の議決をもって行うものとする。

付則

この規程は2019年2月2日から施行し、2019年2月2日から適用する。

改訂来歴

日付	理由及訂正箇所	承認	起案
2008/8/23	初版作成	理事会	長谷川修司
2009/5/23	第一次改訂版	理事会	工藤正博
2009/8/22	第二次改訂版	理事会	工藤正博
2013/2/2	改訂版作成	理事会	一宮彪彦
2014/7/19	第三次改訂版	理事会	大門 寛
2019/2/2	改訂版作成	理事会	長谷川修司

公益社団法人日本表面真空学会 講演奨励賞規程

2019年2月2日理事会承認

(目的)

第1条 公益社団法人日本表面真空学会（以下本会という）は、若手研究者奨励のため、日本表面真空学会講演奨励賞を設け、本規程によって授賞する。

2 本賞は、本会の学術講演会において、表面・真空科学技術の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手会員に対して講演奨励賞を授与し、その功績を称え研究意欲を高めることを目的とする。

(種別)

第2条 本賞には受賞対象者の資格に応じて「講演奨励賞（若手研究者部門）」、「講演奨励賞（新進研究者部門）」および「講演奨励賞（スチューデント部門）」を設ける。

(表彰対象)

第3条 表彰対象は、本会の学術講演会において、表面・真空科学技術の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文（ポスターセッション論文を含む）を発表した個人会員であり、かつ本講演奨励賞をまだ受けていないものであって、表彰対象部門に応じて以下の項目を満たすものとする。

(三部門共通)

- 1) 講演論文の筆頭者であること。
- 2) 登録された登壇者であり、かつ実際に登壇した者であること。
- 3) 講演申込み時に、講演奨励賞に応募（ただし各回1人1件に限る）した者。

(若手研究者部門)

4) 個人正会員であり、発表年の4月1日時点で満33才以上、満39才以下であること。

(新進研究者部門)

5) 個人正会員であり、発表年の4月1日時点で満32才以下であること。

(スチューデント部門)

6) 発表年月日において学生として在籍する学生会員、または発表年の途中まで学生会員として在籍した個人正会員、または、学術講演会委員会において資格ありと認められた者。

2 論文発表者で、会員外（協賛学協会会員および非会員）の者は表彰対象としない。

(選定)

第4条 講演奨励賞選定委員会は、候補者より受賞対象者を選定し、理事会に推薦する。会長は、理事会に諮り、受賞者を決定する。

(表彰)

第5条 受賞者は、本会定例総会、または学術講演会にて表彰する。

2 受賞者には表彰式において賞状を授与する。

(内規)

第6条 受賞対象者の選定を行うにあたり、上記委員会は、必要があれば選定基準内規を作成し、理事会の議を経て、これを規定する。

(規程の改廃)

第7条 この規程の改廃は理事会の議決をもって行うものとする。

付則 この規程は2019年2月2日から施行し、2019年2月2日から適用する。

改訂来歴

日付	理由及訂正箇所	承認	起案
2008/8/23	初版作成	理事会	長谷川修司

2013/2/2	改訂版作成	理事会	一宮彪彦
2013/10/5	改訂版作成	理事会	藤田大介
2016/2/6	改訂版作成	理事会	本間芳和
2019/2/2	改訂版作成	理事会	——

公益社団法人日本表面真空学会 講演奨励賞細則

2019年2月2日理事会承認

(目的)

第1条 学術講演会における「講演奨励賞（若手研究者部門）」、「講演奨励賞（新進研究者部門）」および「講演奨励賞（スチューデント部門）」の選定に関わる申し合わせを定める。

(表彰人数)

第2条 予定表彰人数は、各部門につきそれぞれ一般講演件数の4%を上限する。

(選定方針)

第3条 講演奨励賞規程第4条にもとづき、受賞対象者の選定は下記による。

(1) 審査委員は、講演奨励賞選定委員会において選出する。審査委員は、実際に講演を聴いて選考する。スチューデント部門では、応募者の指導教員および共同研究者はその講演の審査委員にはならない。若手研究者部門および新進研究者部門では、応募講演の共同研究者はその講演の審査委員にはならない。

(2) 学術講演会后、講演奨励賞選定委員会によって、下記の選考基準を参考にして合議により決定する。

(3) 選考基準

- 1) 講演者本人の理解度（スチューデント部門）、講演者本人の理解度（若手研究者部門および新進研究者部門）
- 2) 研究・開発の科学的面白さ、技術的重要さ、独創性や強い特徴があるか
- 3) 結果の解析や処理は妥当であるか
- 4) 考察は結果から論理的に導かれているか
- 5) 研究の意義について学術的、技術的、または社会的な観点から位置付けできているか
- 6) 発表は聞く人の立場にたって、わかりやすく、誤解を生まない配慮がなされているか
- 7) 総合点: 上記の個別点にとらわれず、全体を考慮した評価点
評価得点の合計をもとに、講演奨励賞選定委員会で選考を行う。

追記事項：口頭およびポスター発表の不平等を廃するために学術講演会委員長および副委員長はできるだけ多くの応募講演の審査を行うこと

付則 この細則は2019年2月2日から施行し、2019年2月2日から適用する。

改訂来歴

日付	理由及訂正箇所	承認	起案
2008/8/23	初版作成		長谷川修司
2019/1/23/	改定版作成		長谷川修司

公益社団法人日本表面真空学会 The Heinrich Rohrer Medal 表彰規程

2019年2月2日理事会承認

(定義)

第1条 公益社団法人日本表面真空学会（以下本会という）は、表面・真空科学に基礎をおいたナノサイエンス・ナノテクノロジー分野において世界的に極めて高い評価を受けた功績を顕揚するために The Heinrich Rohrer Medal を設定する。本賞は、上述の分野において相当期間にわたって極めて高い水準の業績を挙げた個人に与えられる「Grand Medal」、および同分野において顕著な成果を挙げ、今後も活躍が期待される 37 才以下の若手研究者に授与される「Rising Medal」からなる。

(対象者)

第2条 本賞は、本会の会員か非会員に関わらず、また国籍、性別、年齢、所属機関などを問わず、世界中の研究者を対象とする。ただし、Rising Medal に限って、表彰年の1月1日現在で37才以下でなければならない。物故者を対象とすることはできない。

2 Grand Medal は1件とし、原則として単独受賞とするが、共同研究者など同一テーマによる複数人の共同受賞も認める。Rising Medal は3件を上限とし、それぞれ単独受賞とする。

(推薦)

第3条 受賞候補者の推薦は下記による。

(1) 候補者の業績を評価できる者であれば本会の会員か非会員に関わらず、また、日本人か外国人かに関わらず誰でも受賞候補者を推薦することができる。

(2) 受賞候補者の推薦に際しては、定められた形式による Nomination Letter、および推薦者以外の者による Supporting Letter をあわせて The Heinrich Rohrer Medal 選定委員会に提出する必要がある。さらに、選考の過程において、The Heinrich Rohrer Medal 選定委員会からの求めに応じて、その他の必要な書類を提出する必要がある。

(選定)

第4条 The Heinrich Rohrer Medal 選定委員会は、「表面科学に関する国際シンポジウム」(International Symposium on Surface Science) が開催される年に、推薦された候補者の中から第2条で定められた数の受賞対象者を選定し、理事会に推薦する。

2 理事会は選考結果の報告を受けて審議し、受賞者を決定する。

(表彰)

第5条 表彰は、メダル、賞状、賞金をもって行う。

(授賞)

第6条 本賞の授賞は、「表面科学に関する国際シンポジウム」にて、在日スイス大使館の協力のもとで行う。

(受賞業績の公開)

第7条 受賞者は、「表面科学に関する国際シンポジウム」にて受賞業績の発表を行なうものとする。

(内規)

第8条 本賞の推薦方法および選考方法について、必要ならば内規を別に定めるものとする。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は理事会の議決をもって行うものとする。

付則

この規程は2019年2月2日から施行し、2019年2月2日から適用する。

改訂来歴

日付	理由及訂正箇所	承認	起案
2014/1/27	初版作成	理事会	長谷川修司
2019/2/2	改訂版作成	理事会	長谷川修司

公益社団法人日本表面真空学会 真空の匠 規程

平成 30 年 9 月 29 日理事会承認

(定義)

第 1 条 公益社団法人日本表面真空学会（以下本会という）は、真空関連技術に長年専心し、あるいは、オリジナルな真空関連技術開発の先鞭をつけた本会の会員に対して日本表面真空学会 真空の匠の称号を授与する。

(対象者)

第 2 条 本会の個人正会員あるいは法人正会員に属する個人を対象とする。

(候補者の推薦)

第 3 条 候補者の推薦は下記による。

(1) 本会名誉会員、功労会員、個人正会員、および法人正会員は、候補者を推薦することができる。

(2) 候補者の推薦に際しては、定められた形式による推薦書および推薦理由書等を、所定の書類に添えて提出する必要がある。

(選定委員会)

第 4 条 学会賞等選定委員会は、推薦された候補者から選定し、会長に推薦する。

(受賞者の決定)

第 5 条 会長は、第 4 条の規定による選考結果の報告を受け、これを理事会に諮り、称号授与者を決定する。

(称号授与)

第 6 条 称号の授与は、賞状をもって行う。

(細則)

第 7 条 候補者の推薦方法および選考方法について、細則を別に定めることができる。

(規程の改廃)

第 8 条 この規程の改廃は理事会の議決をもって行うものとする。

付則

この規程は平成 30 年 9 月 29 日から施行し、平成 30 年 9 月 29 日から適用する。

改訂来歴

日 付	理由及訂正箇所	承認	起案
2018/9/29	初版作成	理事会	荒川一郎